

# 口頭セッション日程表(分科別1)

| 大分類分科名<br>中分類分科名  | 2021年9月10日(金)         |                       | 2021年9月11日(土)         |                       | 2021年9月12日(日)         |                       | 2021年9月13日(月)         |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 午前                    | 午後                    | 午前                    | 午後                    | 午前                    | 午後                    | 午前                    | 午後                    |
| <b>S シンポジウム</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| SP1【一般公開】赤崎勇先生追悼シンポジウム  |                       |                       |                       | N101<br>13:30 ~ 17:55 |                       |                       |                       |                       |
| NT1【一般公開】就活生必見！半導体の進化無くしてAIの進化無し  |                       |                       | S101<br>09:50 ~ 12:10 |                       |                       |                       |                       |                       |
| T1 コロナ禍での物理(科学)教育とその人材育成 -東海地区などの取り組みに学ぶ-   |                       |                       |                       | N102<br>13:30 ~ 15:55 |                       |                       |                       |                       |
| T2【一般公開】空気中の二酸化炭素濃度削減を目指した電解技術の動向   |                       |                       |                       |                       |                       |                       | N201<br>09:00 ~ 11:45 | N201<br>13:30 ~ 17:15 |
| T3 放射線計測技術および材料の現状と最新動向   |                       |                       |                       | N324<br>13:30 ~ 16:45 |                       |                       |                       |                       |
| T4 散乱・揺らぎ計算イメージングの最前線   |                       | N201<br>13:30 ~ 16:55 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| T5 フォトニクスが生み出すイノベーションと新産業創出IV ~羽ばたく産学発<br>フォトニクスベンチャー~  |                       | S201<br>13:00 ~ 17:05 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| T6 グローバル量子暗号通信の展開   |                       | S101<br>13:30 ~ 17:15 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| T7 最先端バイオメテックスが生み出す超高機能フロンティア~知覚-情報<br>処理-行動から発電まで~   |                       | N105<br>13:30 ~ 17:15 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| T8 薄膜・表面物理研究のトレンドと今後の展望 ~薄膜・表面物理分科<br>会50周年記念シンポジウム~  |                       |                       | S201<br>09:00 ~ 12:00 | S201<br>13:00 ~ 18:30 |                       |                       |                       |                       |
| T9 固相における秩序とは何か: 機能を生み出す秩序の概念展開   |                       |                       | N105<br>09:30 ~ 12:00 | N105<br>13:30 ~ 17:15 |                       |                       |                       |                       |
| T10 蓄電固体デバイスの開発に向けた界面イオンダイナミクス  |                       |                       | N203<br>09:00 ~ 12:30 |                       |                       |                       |                       |                       |
| T11 未来デバイス製造のためのアトミックレイヤープロセス; 表面反応ダイナミ<br>クスの理解と制御   |                       |                       | S301<br>09:00 ~ 11:40 | S301<br>13:30 ~ 16:55 |                       |                       |                       |                       |
| T12 多様化する圧電材料研究 ~センサー、アクチュエーターから5G、IoT<br>まで~   |                       |                       |                       | N301<br>13:30 ~ 17:15 |                       |                       |                       |                       |
| T13 理論と実験の協奏: スピントロニクス材料・現象・素子  |                       |                       |                       | S302<br>13:30 ~ 18:00 |                       |                       |                       |                       |
| T14 持続型社会に向けた弱磁場応用  |                       |                       |                       |                       |                       | N324<br>13:30 ~ 17:30 |                       |                       |
| T15 計測×デジタル・IoTがひらく次世代ヘルスケア   |                       |                       |                       | N201<br>13:30 ~ 17:15 |                       |                       |                       |                       |
| T16 カーボンニュートラルに向けて有機分子・バイオエレクトロニクスが<br>できること  |                       | N324<br>13:00 ~ 16:35 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| T17 生命機能メカニズム解明のための光・磁気操作技術   |                       |                       | N201<br>09:00 ~ 12:10 |                       |                       |                       |                       |                       |
| T18 次世代発光材料の創製とデバイス応用   |                       |                       |                       |                       | S201<br>09:00 ~ 11:45 | S201<br>13:00 ~ 15:45 |                       |                       |
| T19 福島第1原発廃炉と福島復興 -応用物理学会の会員として、私た<br>ちに何ができるか-   | N301<br>10:30 ~ 11:45 | N301<br>13:15 ~ 16:15 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| T20 センサ融合に向けたセンサ集積技術  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | S202<br>13:30 ~ 17:40 |
| T21 晶癖の工学: 宇宙がおりなす結晶成長  | N102<br>09:20 ~ 12:00 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| T22 脱炭素社会に向けたカーボンナノチューブの開発と応用~発見30周年<br>記念シンポジウム~   |                       |                       |                       |                       |                       | N105<br>13:30 ~ 18:00 |                       |                       |
| T23 データの蓄積と共有がもたらす革新と課題 ~マテリアルズインフォマテ<br>クスを中心に~  |                       |                       |                       |                       | N201<br>10:00 ~ 11:45 | N201<br>13:30 ~ 16:50 |                       |                       |
| T24【一般公開】量子コンピュータ: システム構築のための技術と期待される<br>アプリケーション   |                       |                       |                       | S101<br>13:30 ~ 18:00 |                       |                       |                       |                       |
| T25 AIアクセラレータ: 人工知能デバイスの新展開   | S101<br>09:00 ~ 12:50 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>FS フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」  |                       |                       |                       |                       | S101<br>09:00 ~ 11:30 | S101<br>13:00 ~ 17:30 | S101<br>09:00 ~ 11:45 |                       |
| <b>CS コードシェアセッション</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| CS.1 2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析、7.5 イオンビーム一般の<br>コードシェアセッション  | N402<br>09:00 ~ 11:30 | N402<br>13:00 ~ 15:45 | N402<br>09:15 ~ 11:30 |                       |                       |                       |                       |                       |
| CS.2 3.3 情報フォトニクス・画像工学、4.4 Information Photonicsの<br>コードシェアセッション  |                       |                       | N202<br>10:45 ~ 12:00 |                       | N404<br>09:00 ~ 12:00 | N404<br>13:30 ~ 18:00 |                       |                       |
| CS.3 3.5 レーザー装置・材料、3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコード<br>シェアセッション  |                       |                       |                       | S202<br>15:45 ~ 16:45 |                       |                       |                       |                       |
| CS.4 3.6 超高速・高強度レーザー、3.7 レーザープロセスング、4.3<br>Lasers and laser materials processingのコードシェアセッション                              |                       |                       |                       |                       |                       |                       | N404<br>09:00 ~ 11:30 | N404<br>13:30 ~ 16:00 |
| CS.5 3.11 フォトニック構造・現象、3.12 ナノ領域光科学・近接場光学の<br>コードシェアセッション  |                       |                       |                       | N205<br>13:30 ~ 16:45 |                       |                       |                       |                       |
| CS.6 3.13 半導体光デバイス、4.2 Photonics Devices, Photonic<br>Integrated Circuit and Silicon Photonicsのコードシェアセッション                | N405<br>09:00 ~ 12:15 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| CS.7 3.15 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス、4.2 Photonics<br>Devices, Photonic Integrated Circuit and Silicon Photonicsの<br>コードシェアセッション |                       | N405<br>13:45 ~ 17:15 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| CS.8 4.5 Nanocarbon and 2D Materials、17 ナノカーボンのコードシ<br>ェアセッション  | N305<br>09:00 ~ 12:15 |                       |                       | N405<br>13:00 ~ 15:30 |                       |                       |                       |                       |
| CS.9 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集<br>積化技術のコードシェアセッション   |                       |                       |                       | N205<br>09:00 ~ 12:00 |                       |                       |                       |                       |
| CS.10 6.5 表面物理・真空と7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術<br>のコードシェアセッション   | N204<br>09:00 ~ 12:15 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| CS.11 8.3 プラズマナノテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート、<br>13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス、15.3 III-V族エピタキシャル<br>結晶・エピタキシーの基礎のコードシェアセッション    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | N323<br>13:00 ~ 16:45 |
| <b>1 応用物理学一般</b>  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1.1 応用物理一般・学際領域   | S401<br>09:00 ~ 12:00 | S401<br>13:30 ~ 17:45 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1.2 教育  |                       |                       | S401<br>09:00 ~ 11:00 |                       |                       |                       |                       |                       |
| 1.3 新技術・複合新領域   |                       |                       |                       |                       | S401<br>09:15 ~ 11:30 |                       |                       |                       |
| 1.4 エネルギー・変換・貯蔵・資源・環境   |                       |                       |                       |                       |                       | S401<br>13:00 ~ 18:15 |                       |                       |
| 1.5 計測技術・計測標準   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | S401<br>13:00 ~ 15:45 |
| 1.6 超音波   |                       |                       |                       | S401<br>13:00 ~ 17:45 |                       |                       |                       |                       |

# 口頭セッション日程表(分科別2)

| 大分類分科名<br>中分類分科名   | 2021年9月10日(金)         |                       | 2021年9月11日(土)         |                       | 2021年9月12日(日)         |                       | 2021年9月13日(月)         |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 午前                    | 午後                    | 午前                    | 午後                    | 午前                    | 午後                    | 午前                    | 午後                    |
| <b>2 放射線</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 2.1 検出器デバイス開発  |                       |                       | N324<br>09:00 ~ 12:00 |                       | N221<br>10:45 ~ 12:00 | N221<br>13:30 ~ 16:30 |                       |                       |
| 2.2 放射線物理一般・放射線応用・発生装置・新技術   | N206<br>09:00 ~ 11:45 | N206<br>13:30 ~ 17:00 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析<br>(※7.5 イオンビーム一般と)のコードシェアセッション   | N402<br>09:00 ~ 11:30 | N402<br>13:00 ~ 15:45 | N402<br>09:15 ~ 11:30 |                       |                       |                       |                       |                       |
| 2.4 医用応用   |                       |                       |                       |                       |                       |                       | N206<br>09:00 ~ 11:30 | N206<br>13:30 ~ 15:00 |
| 2.5 放射線誘起蛍光体   |                       |                       |                       |                       |                       | S202<br>13:00 ~ 18:30 | S202<br>09:30 ~ 12:00 |                       |
| <b>3 光・フォトニクス</b>  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3.1 光学基礎・光学新領域   |                       |                       |                       |                       | N107<br>10:00 ~ 11:15 | N107<br>13:30 ~ 17:00 | N107<br>09:00 ~ 12:15 |                       |
| 3.2 材料・機器光学  |                       | N205<br>13:00 ~ 15:15 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3.3 情報フォトニクス・画像工学<br>※4.4 Information Photonicsとのコードシェアセッション   |                       |                       | N202<br>10:45 ~ 12:00 |                       | N404<br>09:00 ~ 12:00 | N404<br>13:30 ~ 18:00 |                       |                       |
| 3.4 生体・医用光学  |                       |                       |                       |                       |                       |                       | N202<br>09:00 ~ 12:15 | N202<br>14:00 ~ 15:45 |
| 3.5 レーザー装置・材料  |                       |                       | S202<br>10:00 ~ 11:30 | S202<br>13:00 ~ 15:30 |                       |                       |                       |                       |
| CS.3 3.5 レーザー装置・材料、3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション   |                       |                       |                       | S202<br>15:45 ~ 16:45 |                       |                       |                       |                       |
| 3.6 超高速・高強度レーザー  | N107<br>09:00 ~ 12:15 | N107<br>13:30 ~ 16:45 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| CS.4 3.6 超高速・高強度レーザー、3.7 レーザープロセス、4.3 Lasers and laser materials processingのコードシェアセッション                            |                       |                       |                       |                       |                       |                       | N404<br>09:00 ~ 11:30 | N404<br>13:30 ~ 16:00 |
| 3.7 レーザープロセス   | N321<br>09:00 ~ 12:00 | N305<br>13:30 ~ 18:30 | N321<br>09:00 ~ 12:00 | N321<br>13:30 ~ 15:45 |                       |                       |                       |                       |
| CS.4 3.6 超高速・高強度レーザー、3.7 レーザープロセス、4.3 Lasers and laser materials processingのコードシェアセッション                            |                       |                       |                       |                       |                       |                       | N404<br>09:00 ~ 11:30 | N404<br>13:30 ~ 16:00 |
| 3.8 光計測技術・機器   | N106<br>09:00 ~ 11:45 | N106<br>13:30 ~ 16:30 | N106<br>09:00 ~ 11:45 |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3.9 テラヘルツ全般  |                       |                       | S203<br>09:00 ~ 11:30 |                       |                       |                       | N105<br>09:00 ~ 12:00 | N105<br>13:30 ~ 17:15 |
| 3.10 光量子物理・技術  |                       |                       | N103<br>09:00 ~ 11:45 |                       | N103<br>09:00 ~ 12:00 | N103<br>13:30 ~ 17:45 |                       |                       |
| 3.11 フォトニック構造・現象   |                       |                       |                       |                       | N321<br>09:15 ~ 12:00 | N321<br>13:30 ~ 17:45 | N321<br>09:15 ~ 12:00 | N321<br>13:30 ~ 17:45 |
| CS.5 3.11 フォトニック構造・現象、3.12 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション   |                       |                       |                       | N205<br>13:30 ~ 16:45 |                       |                       |                       |                       |
| 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学   |                       |                       |                       |                       | N202<br>09:00 ~ 11:15 | N202<br>13:00 ~ 16:30 | N324<br>09:00 ~ 11:30 | N324<br>13:00 ~ 16:30 |
| CS.5 3.11 フォトニック構造・現象、3.12 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション   |                       |                       |                       | N205<br>13:30 ~ 16:45 |                       |                       |                       |                       |
| 3.13 半導体光デバイス  |                       | N103<br>13:45 ~ 18:00 | N102<br>09:30 ~ 11:45 |                       |                       |                       |                       |                       |
| CS.6 3.13 半導体光デバイス、4.2 Photonics Devices, Photonic Integrated Circuit and Silicon Photonicsのコードシェアセッション            | N405<br>09:00 ~ 12:15 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3.14 光制御デバイス・光ファイバー  |                       |                       |                       |                       |                       | N306<br>13:30 ~ 15:45 | N103<br>09:00 ~ 11:30 | N103<br>13:30 ~ 16:45 |
| CS.3 3.5 レーザー装置・材料、3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション   |                       |                       |                       | S202<br>15:45 ~ 16:45 |                       |                       |                       |                       |
| 3.15 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス   |                       |                       | N207<br>09:30 ~ 12:00 | N207<br>13:30 ~ 17:15 |                       |                       |                       |                       |
| CS.7 3.15 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス、4.2 Photonics Devices, Photonic Integrated Circuit and Silicon Photonicsのコードシェアセッション |                       | N405<br>13:45 ~ 17:15 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>4 JSAP-OSA Joint Symposia 2021</b>  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4.1 Plasmonics and Nanophotonics   | N404<br>09:00 ~ 11:00 | N404<br>13:00 ~ 17:45 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4.2 Photonics Devices, Photonic Integrated Circuit and Silicon Photonics ※3.13 半導体光デバイスとのコードシェアセッション               | N405<br>09:00 ~ 12:15 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4.2 Photonics Devices, Photonic Integrated Circuit and Silicon Photonics ※3.15 シリコンフォトニクス・集積フォトニクスとのコードシェアセッション    |                       | N405<br>13:45 ~ 17:15 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 4.3 Lasers and laser materials processing<br>※3.6 超高速・高強度レーザー、3.7 レーザープロセスとのコードシェアセッション                            |                       |                       |                       |                       |                       |                       | N404<br>09:00 ~ 11:30 | N404<br>13:30 ~ 16:00 |
| 4.4 Information Photonics<br>※3.3 情報フォトニクス・画像工学とのコードシェアセッション   |                       |                       | N202<br>10:45 ~ 12:00 |                       | N404<br>09:00 ~ 12:00 | N404<br>13:30 ~ 18:00 |                       |                       |
| 4.5 Nanocarbon and 2D Materials<br>※17 ナノカーボンとのコードシェアセッション   | N305<br>09:00 ~ 12:15 |                       |                       | N405<br>13:00 ~ 15:30 |                       |                       |                       |                       |
| 4.6 Terahertz Photonics  |                       |                       |                       | N404<br>13:00 ~ 16:00 | N405<br>09:00 ~ 11:30 | N405<br>13:00 ~ 16:00 |                       |                       |
| 4.7 Quantum Optics and Nonlinear Optics  |                       |                       | N307<br>09:00 ~ 12:15 | N307<br>13:30 ~ 14:45 |                       |                       |                       |                       |
| <b>6 薄膜・表面</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 6.1 強誘電体薄膜   |                       |                       |                       |                       | N301<br>09:00 ~ 12:00 | N301<br>13:30 ~ 17:30 |                       |                       |
| CS.9 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェアセッション  |                       |                       | N205<br>09:00 ~ 12:00 |                       |                       |                       |                       |                       |
| 6.2 カーボン系薄膜  |                       |                       |                       |                       | S301<br>09:00 ~ 12:00 | S301<br>14:00 ~ 18:00 | S301<br>09:30 ~ 11:15 | S301<br>13:00 ~ 17:15 |
| 6.3 酸化物エレクトロニクス  | S203<br>09:00 ~ 11:30 | S203<br>13:00 ~ 18:30 |                       |                       | S203<br>09:00 ~ 11:30 | S203<br>13:00 ~ 16:30 | S203<br>09:00 ~ 11:30 | S203<br>13:00 ~ 17:00 |
| 6.4 薄膜新材料  |                       |                       |                       |                       | N203<br>09:00 ~ 11:30 | N203<br>13:30 ~ 16:45 | N203<br>09:30 ~ 11:15 | N203<br>13:30 ~ 16:00 |
| 6.5 表面物理・真空  |                       | N204<br>13:30 ~ 18:30 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| CS.10 6.5 表面物理・真空と7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション  | N204<br>09:00 ~ 12:15 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 6.6 フロー顕微鏡   |                       |                       | N301<br>09:00 ~ 12:00 |                       |                       |                       | N301<br>10:00 ~ 11:30 | N301<br>13:00 ~ 17:45 |

# 口頭セッション日程表(分科別3)

| 大分類分科名<br>中分類分科名   | 2021年9月10日(金)         |                       | 2021年9月11日(土)         |                       | 2021年9月12日(日)         |                       | 2021年9月13日(月)         |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 午前                    | 午後                    | 午前                    | 午後                    | 午前                    | 午後                    | 午前                    | 午後                    |
| 7 ビーム応用  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.1 X線技術   |                       | N307<br>13:30 ~ 17:15 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.2 電子ビーム応用  | N401<br>09:00 ~ 11:30 | N401<br>13:00 ~ 15:45 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.3 微細パターン・微細構造形成技術  |                       |                       | N401<br>09:00 ~ 10:15 |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.4 量子ビーム界面構造計測  |                       |                       | N401<br>10:45 ~ 11:30 |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.5 イオンビーム一般<br>※2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析とのコードシェアセッション   | N402<br>09:00 ~ 11:30 | N402<br>13:00 ~ 15:45 | N402<br>09:15 ~ 11:30 |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術<br>※6.5 表面物理・真空とのコードシェアセッション   | N204<br>09:00 ~ 12:15 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 8 プラズマエレクトロニクス   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 8.1 プラズマ生成・診断  | S301<br>09:00 ~ 11:30 | S301<br>14:00 ~ 16:30 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理  |                       |                       |                       |                       | N102<br>09:00 ~ 11:30 | N102<br>13:30 ~ 17:30 |                       |                       |
| 8.3 プラズマナノテクノロジー   |                       |                       |                       |                       |                       |                       | N323<br>09:00 ~ 12:00 |                       |
| CS.11 8.3 プラズマナノテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート、<br>13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス、15.3 III-V族エピタキシャル<br>結晶・エビタキシーの基礎のコードシェアセッション |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | N323<br>13:00 ~ 16:45 |
| 8.4 プラズマライフサイエンス   |                       |                       |                       |                       | N204<br>13:30 ~ 15:15 |                       |                       | N107<br>13:30 ~ 17:30 |
| 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野  |                       | N322<br>13:30 ~ 18:00 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 8.6 Plasma Electronics English Session   |                       |                       |                       |                       | N204<br>15:30 ~ 17:30 |                       |                       |                       |
| 8.8 プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演  |                       | S301<br>13:00 ~ 14:00 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 9 応用物性   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 9.1 誘電材料・誘電体   | N403<br>09:00 ~ 12:30 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート   |                       | N403<br>13:30 ~ 18:00 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| CS.11 8.3 プラズマナノテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート、<br>13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス、15.3 III-V族エピタキシャル<br>結晶・エビタキシーの基礎のコードシェアセッション |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | N323<br>13:00 ~ 16:45 |
| 9.3 ナノエレクトロニクス   |                       |                       |                       |                       |                       |                       | N403<br>09:00 ~ 11:15 | N403<br>13:00 ~ 15:15 |
| 9.4 熱電変換   | N406<br>09:15 ~ 12:00 | N406<br>13:30 ~ 18:30 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 9.5 新機能材料・新物性  |                       |                       | N104<br>09:30 ~ 11:30 |                       |                       |                       | N406<br>09:30 ~ 11:30 | N406<br>13:00 ~ 17:00 |
| 10 スピントロニクス・マグネティクス  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)   |                       |                       |                       |                       |                       |                       | S302<br>09:00 ~ 12:00 | S302<br>13:30 ~ 17:45 |
| 10.2 スピン基礎技術・萌芽的デバイス技術   | S302<br>09:00 ~ 12:00 | S302<br>13:30 ~ 18:30 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術   |                       |                       | S302<br>09:00 ~ 12:00 |                       | S302<br>09:00 ~ 10:45 |                       |                       |                       |
| 10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関   |                       |                       |                       |                       | S302<br>11:00 ~ 12:00 | S302<br>13:30 ~ 18:15 |                       |                       |
| 10.5 磁場応用  |                       |                       |                       |                       | N324<br>09:00 ~ 11:30 |                       |                       |                       |
| 11 超伝導   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 11.1 基礎物性  |                       |                       |                       | N401<br>13:00 ~ 14:45 | N401<br>10:00 ~ 11:45 | N401<br>13:15 ~ 15:30 |                       |                       |
| 11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長  |                       |                       |                       |                       | N402<br>09:00 ~ 12:00 | N402<br>13:30 ~ 16:15 |                       |                       |
| 11.3 臨界電流、超伝導パワー応用   |                       |                       |                       | N402<br>13:00 ~ 15:45 |                       |                       |                       |                       |
| 11.4 アナログ応用および関連技術   |                       |                       |                       | N403<br>13:00 ~ 14:15 | N403<br>09:00 ~ 11:00 |                       |                       |                       |
| 11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用  |                       |                       |                       |                       |                       | N403<br>13:00 ~ 16:45 |                       |                       |
| 12 有機分子・バイオエレクトロニクス  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 12.1 作製・構造制御   |                       |                       |                       |                       |                       | N307<br>13:30 ~ 16:30 | N302<br>09:30 ~ 12:15 | N302<br>13:30 ~ 17:00 |
| 12.2 評価・基礎物性   |                       |                       | N323<br>09:00 ~ 11:30 | N323<br>13:30 ~ 17:30 | N302<br>09:00 ~ 11:45 | N302<br>13:30 ~ 18:15 |                       |                       |
| 12.3 機能材料・萌芽的デバイス  |                       |                       |                       |                       | N207<br>09:00 ~ 12:00 | N207<br>13:30 ~ 18:00 | N207<br>09:00 ~ 12:00 | N207<br>13:30 ~ 15:45 |
| 12.4 有機EL・トランジスタ   |                       |                       |                       |                       | N205<br>09:00 ~ 12:15 | N205<br>13:45 ~ 17:45 | N205<br>09:00 ~ 12:15 | N205<br>13:45 ~ 17:15 |
| 12.5 有機太陽電池  |                       |                       | N322<br>09:00 ~ 11:30 | N322<br>13:00 ~ 17:15 | N322<br>09:00 ~ 11:30 | N322<br>13:00 ~ 18:30 |                       |                       |
| 12.6 ナノバイオテクノロジー   | N207<br>09:00 ~ 12:00 | N207<br>13:30 ~ 18:00 |                       |                       | S402<br>09:00 ~ 11:45 | S402<br>13:00 ~ 17:00 |                       |                       |
| 12.7 医用工学・バイオチップ   | S402<br>09:00 ~ 12:30 | S402<br>13:30 ~ 18:30 |                       |                       |                       |                       | N322<br>09:00 ~ 12:30 | N322<br>13:30 ~ 18:00 |
| 13 半導体   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション   |                       | N304<br>13:30 ~ 16:15 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 13.2 探索的材料物性・基礎物性  |                       |                       | N304<br>09:00 ~ 12:00 | N304<br>13:30 ~ 17:00 |                       |                       |                       |                       |
| 13.3 絶縁膜技術   |                       | N323<br>13:00 ~ 16:15 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| CS.9 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集<br>積化技術のコードシェアセッション  |                       |                       | N205<br>09:00 ~ 12:00 |                       |                       |                       |                       |                       |
| 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術   | N302<br>10:30 ~ 12:00 | N302<br>13:30 ~ 17:45 |                       |                       | N323<br>09:45 ~ 12:00 | N323<br>13:00 ~ 16:15 |                       |                       |
| 13.5 デバイス/配線/集積化技術   |                       |                       |                       |                       | N304<br>09:00 ~ 12:00 | N304<br>13:30 ~ 17:15 | N304<br>09:00 ~ 12:00 |                       |
| CS.9 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集<br>積化技術のコードシェアセッション  |                       |                       | N205<br>09:00 ~ 12:00 |                       |                       |                       |                       |                       |

# 口頭セッション日程表(分科別4)

| 大分類分科名<br>中分類分科名   | 2021年9月10日(金)         |  | 2021年9月11日(土)         |                       | 2021年9月12日(日)         |                       | 2021年9月13日(月)         |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | 午前                    | 午後   | 午前                    | 午後                    | 午前                    | 午後                    | 午前                    | 午後                    |
| <b>13 半導体</b>  |                       |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス  |                       |  |                       |                       |                       | N303<br>13:30 ~ 16:30 |                       |                       |
| CS.11 8.3 プラズマテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート、<br>13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス、15.3 III-V族エピタキシャル<br>結晶・エピタキシーの基礎のコードシェアセッション |                       |  |                       |                       |                       |                       |                       | N323<br>13:00 ~ 16:45 |
| 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価  |                       |  | N305<br>09:00 ~ 12:00 | N305<br>13:30 ~ 16:15 | N305<br>09:00 ~ 11:45 | N305<br>13:30 ~ 17:15 | N305<br>09:00 ~ 11:45 |                       |
| 13.8 光物性・発光デバイス  | N303<br>09:00 ~ 11:45 | N303<br>13:30 ~ 18:30                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 13.9 化合物太陽電池   |                       |  | N204<br>09:30 ~ 12:15 | N204<br>13:30 ~ 17:00 |                       |                       |                       |                       |
| <b>15 結晶工学</b>   |                       |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 15.1 バルク結晶成長   | N221<br>10:00 ~ 12:00 | N221<br>13:30 ~ 16:15                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶  |                       | N321<br>13:00 ~ 13:45                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎   |                       |  |                       |                       | N406<br>09:00 ~ 12:00 | N406<br>13:00 ~ 16:15 |                       |                       |
| CS.11 8.3 プラズマテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート、<br>13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス、15.3 III-V族エピタキシャル<br>結晶・エピタキシーの基礎のコードシェアセッション |                       |  |                       |                       |                       |                       |                       | N323<br>13:00 ~ 16:45 |
| 15.4 III-V族窒化物結晶   | N101<br>09:30 ~ 11:30 | N101<br>13:00 ~ 18:30<br>N102<br>13:30 ~ 16:30 | N101<br>09:00 ~ 11:30 |                       | N101<br>09:00 ~ 11:45 | N101<br>13:00 ~ 18:30 | N101<br>09:00 ~ 11:30 | N101<br>13:00 ~ 18:00 |
| 15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶  | N202<br>09:30 ~ 12:00 | N202<br>13:30 ~ 18:30                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 15.6 IV族系化合物 (SiC)   |                       | S202<br>13:00 ~ 17:00                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 15.7 結晶評価、不純物・結晶欠陥   | N203<br>09:00 ~ 11:45 | N203<br>13:30 ~ 16:00                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>16 非晶質・微結晶</b>  |                       |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス   |                       |  |                       | N104<br>13:30 ~ 17:00 | N104<br>09:00 ~ 11:45 | N104<br>13:30 ~ 15:15 |                       |                       |
| 16.2 エナジーハーベスティング  |                       |  |                       |                       |                       |                       | N405<br>09:00 ~ 10:15 |                       |
| 16.3 シリコン系太陽電池   | N104<br>09:00 ~ 11:30 | N104<br>13:00 ~ 18:15                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>17 ナノカーボン</b>   |                       |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 17.1 カーボンナチューブ、他のナノカーボン材料  |                       |  |                       | N306<br>15:45 ~ 17:45 | N306<br>09:00 ~ 11:30 |                       | N306<br>09:00 ~ 12:00 | N306<br>13:30 ~ 15:45 |
| 17.2 グラフェン   | N306<br>09:00 ~ 12:00 | N306<br>13:30 ~ 18:15                          | N306<br>09:00 ~ 12:00 |                       |                       |                       |                       |                       |
| 17.3 層状物質  |                       |  | N302<br>09:00 ~ 12:00 | N302<br>13:30 ~ 17:00 | N307<br>09:00 ~ 12:00 |                       | N307<br>09:00 ~ 12:00 |                       |
| CS.8 4.5 Nanocarbon and 2D Materials、17 ナノカーボンのコードシ<br>アセッション  | N305<br>09:00 ~ 12:15 |  |                       | N405<br>13:00 ~ 15:30 |                       |                       |                       |                       |
| <b>21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」</b>   |                       |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」  |                       |  |                       |                       | N206<br>09:00 ~ 11:30 | N206<br>13:00 ~ 18:15 | S201<br>09:00 ~ 11:30 | S201<br>13:00 ~ 16:45 |
| <b>22 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」</b>   |                       |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」  |                       |  |                       |                       | N106<br>09:30 ~ 12:00 | N106<br>13:30 ~ 16:45 | N106<br>10:30 ~ 11:45 | N106<br>13:30 ~ 15:00 |
| <b>23 合同セッションN「インフォマティクス応用」</b>  |                       |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」   |                       |  | N107<br>09:00 ~ 12:00 | N107<br>13:30 ~ 18:00 |                       |                       |                       |                       |